2023年11月5日現在

SMTライン構成

ライン	構成	メーカー	形式	シリアルNo.	精度	対象部品	各設備の対応基板サイズ	生産可能基板サイズ	導入時期
1	印刷機	パナソニック	SP60P-MU		±0.025mm	枠サイズ　600X550～736X736	Min 50X50～Max 510X460 T0.6～3.0	Min 100X80～Max 約280X250 T0.6～3.0	2023/05
	印刷検査機	CKD	VP3000	ML-31849	3σ10% 体積	解像度XY12μmZ3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～3.0	↑	2007/05
	モジュラーマウンター	富士機械	NXT(M3X4 M6X2)	002681 002686	±0.03mmリード部品	0603～□100X90 T25	Min 50X50～Max 548X510 T0.4～4.0	↑	2007/05
	リフロー炉(大気)	エイテック	A30-102LRF	3188-06	－	基板上20mm　下10mm	Min 100X50～Max 540X380(反り防止有	↑	2007/05
	外観検査機	マランツ	L22XDL-350	MIX1060339	±0.02mm	－	Min 50X50～Max 350X250 T0.6	↑	2007/05
2	印刷機(検査機能付き)	パナソニック	SP80P-L	1L8V0016	±0.025mm	枠サイズ　600X550～736X736	Min 50X50～Max 510X460 T0.6～3.0	Min 50X80～Max 330X250 T0.6～3.0	2004/03
	印刷検査機	CKD	VP3000	ML-31913	3σ10% 体積	解像度XY12μmZ3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～3.0	↑	2007/06
	高速マウンター	パナソニック	CM88C-M	116Z0219	±0.1mm	1005～□24X24　T6.5	Min 50X50～Max 330X250 T0.6～3.0	↑	2005/07
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	125V3021	±0.035mm	1005～□100X90　T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑	2006/03
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-825GTⅡ	9222205	－	上部10～35mm(基板厚含む)下部10～25mm(可変機能	Min 100X50～Max 400X250(反り防止有	↑	2022/12
	外観検査機	マランツ	V22XDL-350L	VIX0900010	±0.05mm	基板上40mm下60mm(RGB照明およびML照明の場合は基板上30mm)	Min 50X50～Max 350X250 T0.6～3.0	↑	2023/02
3	印刷機	パナソニック	SP28P-DH	1E8V0210	±0.025mm	枠サイズ　600X550～736X736	Min 50X50～Max 330X250 T0.6～3.0	Min 50X80～Max 330X250 T0.6～3.0	2003/06
	印刷検査機	CKD	VP3000	ML-31914	3σ10% 体積	解像度XY12μmZ3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～3.0	↑	2007/06
	高速マウンター	パナソニック	CM88S-M	166Z0414	±0.1mm	1005～□24X24　T6.5	Min 50X50～Max 330X250 T0.6～3.0	↑	2003/06
	異形マウンター	パナソニック	CM401-F	114V0041	±0.035mm	1005～□100X90　T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑	2006/03
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	125V0040	±0.035mm	1005～□100X90　T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑	2004/03
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-1050GT	9317038	－	上部10～35mm(基板厚含む)下部5～25mm(可変機能	Min 50X50～Max 500X500(反り防止有)	↑	2018/02
	外観検査機	マランツ	L22XDL-520	MIX1250269	±0.05mm	－	Min 50X50～Max 520(545)X460 T0.6～3	↑	2005/12
4	印刷機	天竜精機	TSP1200	308180	±0.015mm	枠サイズ　736X736～800X800	Min 50X50～Max 640X460 T0.6～4.0 ※注1	Min 85X80～Max 510X460 T0.6～3.0	2010/07
	印刷検査機	CKD	VP6000L-V-C	ML-60044	3σ2% 体積	解像度XY15μm/7.5μm切り替え Z3μm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～5.0	↑	2019/05
	モジュラーマウンター	富士機械	NXT(M3X4 M6X2)	002696 002667	±0.03mm	0603～□100X90 T25	Min 50X50～Max 548X510 T0.4～4.0	↑	2007/05
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	125V0173	±0.035mm	1005～□100X90　T25	Min 85X80～Max 650X460 T0.3～3.0	↑	2002/01
	リフロー炉(N2)	エイテック	NR06-82L50-RLF	6095-08	－	基板上10mm　下5mm	Min 70X50～Max 600X500(反り防止有)	↑	2010/07
	外観検査機	マランツ	L22XDL-520	MIX12500268	±0.05mm	－	Min 50X50～Max 520X460 T0.6～3.0	↑	2005/12
5	印刷機	天竜精機	TSP1200	308090	±0.015mm	枠サイズ　736X736～800X800	Min 50X50～Max 640X460 T0.6～4.0 ※注1	Min 85X80～Max 640X460 T0.6～3.0	貸与
	高速マウンター	パナソニック	CM402-L	115V0759	±0.05mm	0603～□24X24　T6.5	Min 85X80～Max 650X460 T0.3～3.0	↑	2004/03
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	125V0067	±0.035mm	1005～□100X90　T25	Min 85X80～Max 650X460 T0.3～3.0	↑	2003/06
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-1050GT	9319001	－	上部10～35mm(基板厚含む)下部5～25mm(可変機能	Min 50X50～Max 640X500(反り防止有)	↑	2019/04
	外観検査機	マランツ	U22X-FDL-650L	UIX0880462	±0.05mm	－	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0	↑	2018/09
その他の設備	N2発生装置	大陽日酸	TNGSH-63-RE80FE/NV	－	－	－	－		2018/11
	塗布機	ヤマハ	HSG-Xg	－	±0.1mm	1608～	Min 50X50～Max 460X440　T0.3～3.0		2011/08
	恒温槽	yamato	DN-42	217208	0℃～210℃	－	－		
	恒温槽	yamato	DN-43	－	0℃～210℃	－	－		
	McDRY	ERC	DXU-1001	50866	740W	－	－		
	McDRY	ERC	DXU-501	8371	370W	－	－		貸与
	X線検査装置	ビームセンス	FLEX-M863	FM1130055	－	－	Min 50X50～Max 340X260		2011/02
	X線検査装置	ノードソン	QUADRA 3	XQ222220	－	－	Max660X550(テーブルトレイサイズ)	407X445(最大検査エリア)	2020/10
	X線チップカウンター	TECHVALLEY	HAWKEYE1000	HE10-210704	99.9%	180mm～380mm・スティック・トレイ　※注3	－		2021/08
	半田膜厚検査機	マルコム	TD-3	0418011	－	－	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～2.0		2005/10
	撹拌機	シンキー	SR-500	SR10176	－	－	－		2016/12
	フィクスチャレステスター	タカヤ	APT-7400CJ	J4F43107	－	－	Min50×50～Max640×460 T0.6～3.0		2014/03
	外観検査機	マランツ	U22X-FMA350	M2X0464061	±0.03mm	－	Min 50X50～Max 350X250 T0.5～3.0		2016/05
	外観検査機	マランツ	U22X-FMA650	U2X0460568	±0.03mm	－	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0		2016/05
	外観検査機	マランツ	U22X-FMA650	U2X0980621	±0.03mm	－	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0		2018/09
レーザーマーカー	M/XL兼用マガジン式基板供給装置	小松電子	ELB23XC	AAL054-1-1	－	基板反り　最大±2.0mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2022/03
	レーザーマーキング装置		LMK08X-K	A21055-1-1	±0.5mm	基板反り　最大±1.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2023/07
	駆動式基板クリーナー		ECU46XCD	A21055-2-1	－	基板反り　最大±0.5mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2023/07
	基板反転機		EF100X-K	A21155-1-1	－	基板反り　最大±2.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2023/07
	レーザーマーキング装置		LMK08X-K	AAL054-2-1	±0.5mm	基板反り　最大±1.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2022/03
	駆動式基板クリーナー		ECU46XCD	AAL054-3-1	－	基板反り　最大±0.5mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2022/03
	M/XL兼用マガジン式基板収納装置		EUB23XC	AAL054-4-1	－	基板反り　最大±2.0mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0		2022/03

※注1　両面実装基板で裏面の実装密度が高い場合、又FPC基板等は、サポート方法に別途打合せが必要となります。
※注2　リフローチェッカーの幅がMin80mmです。
※注3　サイズ、形状によって測定不可部品もあります。

DIP	外観検査機	マランツ	U22X-HML650	U2X0600178	±0.03mm	－	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0		2010/07